施設名	大森貝塚遺蹟庭園
所在地	大井6-21-6

【測定理由の分類】
A:雨水が集まるところ及びその出口
B:植物及びその根元
C:雨水･泥･土がたまりやすいところ
D:微粒子などが付着しやすい構造物
その他:A～Dに分類されないもの

測定箇所	測定年月日	測定理由	測定結果（μsv/時）
ベンチ	平成23年11月28日	その他	0.10
ミスト噴水部		C	0.11
横断側溝		A	0.10
植込地		B	0.10
ベンチ		その他	0.10
貝塚展示ブース		その他	0.11
横断側溝		A	0.10
植込地		B	0.10